



オール・イン・ワン CVD装置

(* 概要 *)

本装置は、プロセスユニット部、ガス制御部、シリンダーキャビネット部、電気制御部を1.3m×1.3mのフットプリントに設置した、オール・イン・ワンCVD装置です。

(* 主な仕様 *)



1. プロセスユニット部

リアクタ：横型円筒石英リアクタ
2インチ×1枚用
高周波誘導加熱方式
(最高加熱温度 / 1500)

プロセス排気：メカニカルブースタポンプ
ロータリーポンプ

2. ガス制御部

ガス制御：MFCによる流量制御方式
ラン/ベントバルブ切換方式

3. シリンダーキャビネット部

10リットルシリンダー×3本

4. 電気制御部

シーケンサーによるインターロック機能
異常時処理機能
PCによる自動成長プログラミング機能

5. ユーティリティ

必要電力：3相、200V、150A
冷却水：最大40リットル/min
圧縮空気：圧力約5kg/cm²・G
重量：750kg
外形寸法：W1300×D1300×H2200

株式会社エピクエスト EpiQuest, Inc.

〒601-8142 京都市南区上鳥羽中河原 5 1

TEL 075-693-3356 FAX 075-693-3357

E-mail info@epiquest.co.jp URL <http://www.epiquest.co.jp>